白金表面における振動励起メタン分子の解離吸着反応

植田寛和1·Li CHEN2·Rainer D. BECK3

「物質・材料研究機構 若手国際研究センター 〒 305-0047 茨城県つくば市千現 1 丁目 2-1 ²Department of Dynamics at Surfaces, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Am Faßberg 11, Göttingen, Germany ³Laboratoire de Chimie Physique Moléculaire, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland

(2015年8月17日受付; 2015年10月12日掲載決定)

State-Resolved Methane Dissociation on Pt(111) Studied by Reflection Absorption Infrared Spectroscopy

Hirokazu Ueta¹, Li Chen² and Rainer D. Beck³

¹International Center for Young Scientists, National Institute for Materials Science, 1–2–1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki 305–0047 ²Department of Dynamics at Surfaces, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Am Faßberg 11, Göttingen, Germany ³Laboratoire de Chimie Physique Moléculaire, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland

(Received August 17, 2015; Accepted October 12, 2015)

The dissociation of methane on Pt(111) was studied using quantum state-resolved methods and reflection absorption infrared spectroscopy (RAIRS), at a surface temperature of 150 K where the nascent reaction products methyl(ads) and H(ads) are stable and accumulate on the surface. RAIRS used here for state-resolved reactivity measurements, enables us to monitor the methyl(ads) uptake during molecular beam deposition. The results show that methane dissociation is not only both translationally and vibrationally activated process but also can be bond-selective.

KEYWORDS: methane, platinum, ro-vibrational excitation, surface

1. はじめに

水蒸気改質は今後益々需要が高まるであろう水素製造法としてきわめて重要なものである。この水蒸気改質における律速段階の一つとして、メタン分子の解離反応がある。この反応過程を理解することは学術的な興味だけでなく、工業的にも重要なものであり、これまで幅広く実験的・理論的に研究されている 1,2)。超音速分子線技術を用いて、ノズル温度 (T_n) や混合がス種(希ガスや水素分子)または混合比を変えることで並進運動エネルギー (E_n) を制御し、初期吸着確率 (S_0) の計測がされてきた。ノズルを加熱した場合、ノズルから噴出された分子の振動状態は、回転状態と違ってほぼ冷却された分子の振動状態は、回転状態と違ってほぼ冷却されることなく保持される。したがって、計測される反応性は熱的に振動励起された状態の分子を含む平均的なものとなる。近年、分子線技術と赤外レーザーを用いて、特定の

E-mail: UETA.Hirokazu@nims.go.jp

回転 (J)・振動 (ν) 状態のメタン分子の初期吸着確率が計測されている $^{3,4)}$ 。

本稿では、メタン分子の状態分解反応性計測に赤外分 光法を導入した研究結果を紹介する。

2. 実 験 方 法

本研究で用いた実験装置は三段で差動排気される分子線源と超高真空チャンバーで構成される 5)。超高真空チャンバーには残留ガス分析器(residual gas analyzer, RGA), Ar^+ スパッタガン,オージェ電子分光(Auger electron spectroscopy,AES)が備えついている。RGA は真空計と組み合わせて分子線のフラックス計測,King & Wells 法 6 1による吸着確率計測や昇温脱離(thermal desorption spectroscopy,TDS)計測に用いた。Pt(111)表面は,室温での Ar^+ スパッタリング, 5×10^{-6} Pa の O_2 雰囲気中において表面温度(T_s)700 K で 5 分間加熱した後, O_2 を排気し 1200 K で 2 分間の加熱を繰り返すことで清浄化を行った。清浄性は AES で確認した。

また、表面における反射赤外吸収分光 (reflection absorption infrared spectroscopy, RAIRS) を行うため、フー リエ変換赤外分光計(Fourier transform infrared spectrometer, FTIR, Bruker Vertex V70) および外部赤外検出器が 超高真空チャンバーに接続されている。赤外検出器は InSb 検出器を用いた。この RAIRS 測定によって、表面 吸着種を同定することが可能となる。過去のメタン分子 の状態分解反応性計測では、主に AES で表面の炭素量、 また TDS で脱離してくるメタン分子を検出してきた³⁾。 しかし、これらの場合、ある一定時間メタン分子を照射 後、その都度 AES または TDS を行うため非常に測定時 間がかかることになる。また、AESで用いる高エネル ギーの電子線照射に伴い、表面吸着種を破壊してしまう 可能性もあり、TDS では加熱により生成物を分解して しまう恐れもある。一方、RAIRS 計測で用いられる IR 光は非常に弱く、吸着種を破壊または脱離させることな くメタン分子線照射中にその場でオンラインに RAIR ス ペクトルを得ることが可能である。この利点を用いるこ とで、吸着種構造の同定だけでなく、3.1節で示すよう に一連のアップテーク曲線が得られる。

CH4の状態分解反応性を計測するため、IR 波長可変 V - H - (optical parametric oscillator, OPO, Lockheed Martin Aculight Corp., Argos 2400) を用いて特定の励起分 子を用意した。レーザーは分子線源室内のノズル―スキ マー間を通過し、ノズルから噴出された分子と交差する ことで、特定の回転・振動励起状態のメタンを含む分子 線を生成した。3.1節で示す CH4の解離吸着では 3038.49 cm⁻¹の R(1) 遷移を介して非対称伸縮モード(ν₃)を励 起した分子を用意した。OPO 出力波長は、室温の 3 Pa 程度の CH4 を満たしたガスセルに OPO を入射し、得ら れる吸収線中の Doppler-free の Lamb dip にロックするこ とで安定化を図った⁷⁾。ノズルから断熱膨張的に噴出さ れた分子の回転状態は冷却される。特定の回転・振動状 態に励起した分子を用いた実験条件での分子線の回転温 度は 11~13 K であった。この回転温度範囲では J=1, $\nu=0$ の分子が最も高く占有するため、R(1) 遷移を用い て Rapid adiabatic passage⁸⁾によって入射分子線の約 50% がJ=2, $\nu_3=1$ 状態の分子を用意することが可能となっ た。また、本実験で用いた最低エネルギーの CH_4 (E_t = 0.23 eV) の励起位置から Pt(111)表面までの飛行時間は 約180マイクロ秒であり、この時間は励起状態の緩和時 間 (~数十ミリ秒) よりも十分に短いため、Pt(111)表 面近傍まで ν₃=1の状態は保持されている。

厳密には回転状態についても議論しなければならないが、過去に Ni(100)表面上での CH_4 の解離反応において、 $\nu_3 = 1$ 状態で四つの異なる回転状態 (J = 0, 1, 2, 3)

の反応性計測の報告があるが、回転励起によって反応性 は 2 倍以上変わることがないことが報告されている⁹⁾。

メタン分子の E_1 は、He による希釈(1~3%)および ノズル加熱(300~850 K)によって制御した。分子線は すべて表面垂直方向から照射した。

Pt(111)表面上でのメタンの解離生成物はメチル基と水素原子である。 $T_s \sim 220 \, \mathrm{K}$ 以上の表面で脱水素化および会合脱離が起きることが知られており $^{10\sim 12}$,解離生成物を保持するため,本稿で示す実験結果はすべて $T_s = 150 \, \mathrm{K}$ で得られたものである。

3. 実験結果と考察

3.1 CH₄の解離吸着反応における並進運動と振動エネルギーの影響^[3]

Fig. 1 に E_1 = 0.79 eV の CH₄ 分子照射中に得られた一連の RAIR スペクトルを示す。各スペクトルは分解能 4 cm⁻¹ で記録されたものである。CH₄ 照射とともに 2755 cm⁻¹ と 2883 cm⁻¹ に吸収ピークが現れ,強度が増えていくのが見られる。これらのピークはそれぞれ CH₃ の非対称変角振動モードの倍音および対称伸縮振動モードに対応し,過去の報告と一致する¹¹⁾。この 2883 cm⁻¹ のピーク強度は表面 CH₃ 被覆率 (θ_{CH_3}) と線形の関係にあることは確認している(文献⁵⁾の Fig. 7 参照)。この線形関係を利用して,ピーク強度を θ_{CH_3} へ変換し,またRGA で CH₄ の照射量を計測することで,Fig. 2 に示すようなアップテーク曲線が得られる。Fig. 2 (a) は, E_1 を $0.48\sim0.79$ eV の範囲で制御して得られた結果(laser-

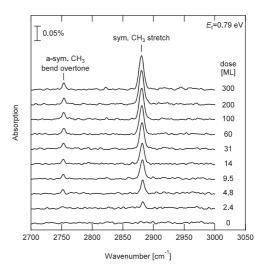


Fig. 1. A series of RAIR spectra collected during $E_1 = 0.79$ eV CH₄ molecular beam deposition on a Pt(111) surface at $T_s = 150$ K. Two peaks correspond to the anti-symmetric CH₃ bend overtone and the symmetric CH₃ stretch absorptions respectively.

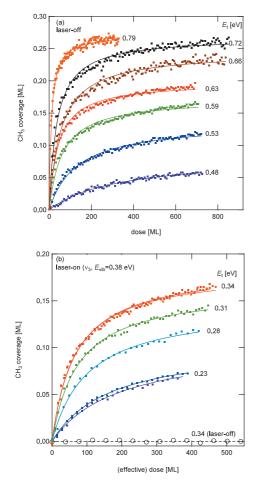


Fig. 2. (color online). (a) RAIRS-detected uptake curves of CH₃(ads) coverage on Pt(111) at T_s = 150 K as a function of incident CH₄ dose for different incident translational energies E_t (laser-off condition). (b) CH₃ (ads) uptake curves for incident ν_3 -excited CH₄. Open circles correspond to the laser-off result with the highest E_t of 0.34 eV used for the laser-on experiments which demonstrates that the observed CH₃ coverage is only due to incident ν_3 -excited CH₄.

off)である。CH4の照射とともに解離反応は進行し、 E_1 の増加とともに CH3 被覆率は急速に増加する。この結果より、CH4の解離吸着は並進運動エネルギーで活性化されることがわかる。得られた各アップテーク曲線をLangmuir のアップテークモデルでフィッティング解析することにより、初期吸着確率 (S_0) および飽和被覆率(θ_{sat}) を決定することができ、それらの値は Fig. 3 (a) および (b) にそれぞれ示す。この一連の実験では、 E_1 は He との混合比のほかにノズルを加熱して制御している。過去に Luntz と Bethune はノズル温度 300 K と 680 K で同じ E_1 の範囲内 $(E_1=0.30\sim0.55\,\text{eV})$ の S_0 を計測しており 14 、 $T_n=680\,\text{K}$ で得られた S_0 の値は $T_n=300\,\text{K}$ での結果よりおよそ 2 倍高く、熱的に振動された分子が反応に寄与することを報告している。したがって、本研

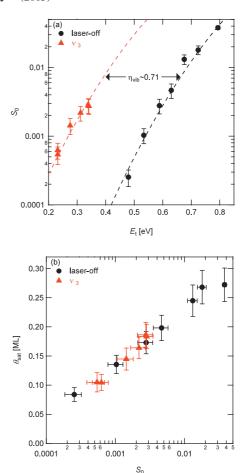


Fig. 3. (color online). (a) Initial sticking probability S_0 of CH₄ on Pt(111) for laser-off and state-specific excitation of the ν_3 as a function of incident translational energy E_1 . Dashed lines are S-shaped reactivity curves fitted to the data to determine a vibrational efficacy $\eta(\nu_3)$ of ~ 0.71 . (b) CH₃(ads) saturation coverage as a function of initial sticking probability S_0 (laser-off) and $S_0(\nu_3)$.

究での laser-off 実験結果にもノズル内で熱的に振動励起された分子は反応に寄与していることが考えられ、ここで示す laser-off の結果は、振動基底状態の反応性の上限であることに留意する。

Fig. 2 (b) に ν_3 = 1 に励起した CH₄ の結果 (laseron) を示す。 E_1 は $0.23\sim0.34$ eV の範囲で制御して実験を行った。比較として,laser-on 実験で用いた最大 E_1 = 0.34 eV の条件での laser-off 実験結果も示す。 E_1 = 0.34 eV の laser-off 実験では,CH₃ は検出限界以下あったことから,laser-on の結果で検出された CH₃ は ν_3 = 1 の CH₄ の解離反応によるものである。Fig. 2 (b) の laser-on 実験のアップテーク曲線の横軸は, ν_3 = 1 励起 CH₄ の照射量に変換してある。つまり,laser-on のアップテーク曲線を laser-off 実験結果と同様に解析することで, ν_3 = 1,J = 2 状態の $S_0(\nu_3)$ と θ_{sat} を得ることができ,Fig.

3 (a) および (b) にそれらの結果を示す。反応における E_{τ} および ν_3 励起の影響を比べるため, S_0 (laser-off) と $S_0(\nu_3)$ を Luntz によって提案された S 字形反応性曲線モデル $^{15)}$

$$S_0 = \frac{A}{2} \left[1 + erf\left(\frac{E_t - E_0}{W}\right) \right] \tag{1}$$

でフィッティング解析を行った。ここで、A は E_i $\rightarrow \infty$ での S_0 の値で 1 とし、 E_0 は平均の活性化障壁高さで、W は Gaussian 分布を仮定した障壁高さの幅に対応する。まず、 S_0 (laser-off) を式 (1) でフィッティングし、 E_0 (laser-off) および W の値を得る。障壁高さの幅は $CH_4(\nu_3)$ においても CH_4 (laser-off) と変わらないとし、 $S_0(\nu_3)$ 結果を同様にフィッティングすることで $E_0(\nu_3)$ が得られる。 ν_3 振動励起の効果 $\eta(\nu_3)$ は、 E_0 (laser-off) と $E_0(\nu_3)$ の差 (ΔE_0) と ν_3 = 1 のエネルギー(~ 0.38 eV)の比、

$$\eta\left(\nu_{3}\right) = \frac{\Delta E_{0}}{h\nu_{3}} = 0.71\tag{2}$$

Fig. 3 (b) に laser-off および laser-on 実験で得られた θ_{sat} を S_0 の関数でプロットしたものを示す。この図より S_0 が高いほど θ_{sat} も高くなることがわかる。また,laser-on の結果は laser-off で得られた結果と同様の傾向を示していることから, θ_{sat} は E_{t} によって決定されているのではなく,反応性に依存することがわかった。

過去の報告では、用いられる実験手法の都合もあり、主に S_0 に注目されて研究されてきた。しかし、RAIRS を導入することで、 S_0 に加えて $\theta_{\rm sat}$ まで決定することが可能となり、清浄表面だけでなく吸着種の存在する表面における反応性についても新たな知見が得られた。

3.2 メタンの解離吸着反応における結合選択性18)

前節でも述べたように、CH4の解離生成物はCH3とHであるが、四つのC-H結合のどの結合が切れたのかは識別できない。しかし、部分的重水素(D)置換したメタンの場合、C-HとC-D結合の二つの解離経路が存在する。過去にNi(111)表面上でのCHD3の解離反応に

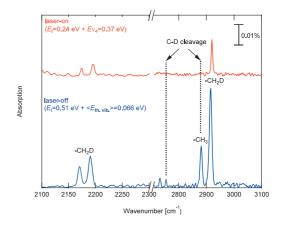


Fig. 4. (color online). A comparison of RAIRS spectra after 80 min deposition of CH₃D on Pt(111) at $T_s = 150$ K for the laser-off condition (bottom); for the ν_4 -excited laser-on condition (top).

おいて、表面下の原子状水素の特性を巧みに使い TDS を用いて、C-H 結合振動励起による結合解離の選択性を示す報告がある 19 。本研究では、全 3 種類の部分的 D 置換 したメタン(CH_3 D、 CH_2 D2、 CHD_3)を用い、RAIRS の利点である吸着種の同定を利用することで、どの結合が切れたのかを解明することが可能である。ここでは、一例として CH_3 D の解離吸着について紹介する。

 $T_s = 150 \text{ K}$ の Pt (111) 表面に $T_n = 700 \text{ K}$ で熱的に活性 化させた $E_t = 0.51 \text{ eV}$ の CH_3D を照射した後の RAIR ス ペクトル (laser-off) と 3017.26 cm⁻¹ の ^oQ(1) 遷移を介 して非対称 C-H 伸縮モード (ν₄) を励起させた CH₃D 照射後の RAIR スペクトル (laser-on) をそれぞれ Fig. 4 に示す。なお、laser-on 実験は、ノズル温度を低下させ ノズル内での熱振動励起を抑え、IR レーザーによる v4 振動が主な励起となる条件で行っている。観測された各 吸収ピークは、laser-off 条件で CH₄ および CH₂D₂ 分子 を照射後に得られた RAIR スペクトルと比較すること で、それぞれ CH3 および CH2D に由来することがわか る^{5,18)}。3.1節で示した CH₄の実験と同様に、照射中に RAIR スペクトルを記録し、各 CH3 および CH2D の吸収 ピーク強度を表面被覆率に変換した後のアップテーク曲 線を Fig. 5 に示す。y 軸は C-H および C-D 結合解離生 成物の飽和被覆率の和が1となるように規格化してあ る。Fig. 5 より、laser-off 実験での C-H: C-D 結合解離 分岐比は 77±1%:23±1% であった。この分岐比は CH₃D を構成する C-H および C-D 結合の統計分布限界 とほぼ一致する。一方, laser-on 実験では C-H 結合のみ が切れて解離反応が進行していることが明らかになっ た。

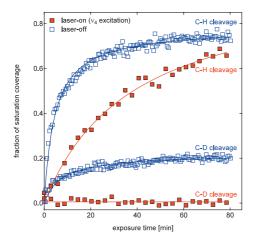


Fig. 5. (color online). Methyl product uptake curves for CH₃ D incident on Pt(111) at $T_s = 150$ K for the laser-off condition (open square); for the ν_4 -excited laser-on condition (filled square).

laser-off 実験では、ノズルを加熱したため $(T_n = 700)$ K) ノズル内で一部の分子は熱的に振動励起しており, その平均熱振動エネルギー $(\langle E_{th.vib} \rangle)$ は $0.066 \, \text{eV}$ であ った。ここで、Etと振動エネルギーの和を総エネルギ ー (Etotal) とした場合, laser-off 実験では Etotal = 0.58 eV $(=E_t + \langle E_{th. \, vib} \rangle)$, laser-on 実験では $E_{total} = 0.61 \, \text{eV}$ $(=E_t$ $+E_{\nu_4}$) であった。laser-off および laser-on 実験条件での Etotal は同程度であるにもかかわらず、C-H/C-D 解離分 岐比は大きく異なるものとなった。他の部分的 D 置換 したメタン分子 (CH₂D₂, CHD₃) においても同様な条 件で実験を行った結果, laser-off 条件での C-H/C-D 解 離分岐比はほぼ統計分布限界と一致したが、C-H 伸縮振 動を励起した場合, C-H 結合のみが切れており, すべて の部分的 D 置換メタン分子の解離反応において振動励 起による結合選択性が明らかになった¹⁸⁾。気相中で C-H 結合を振動励起した分子は表面に接近すると、表面と の相互作用により分子内での振動エネルギーの再分配が 起こる可能性がある。しかし、観測された結合選択性の 結果は、反応時間スケール (~サブピコ秒) において C-H 結合から C-D 結合への振動エネルギーの移動は無 視できるものであることを示唆する。

4. ま と め

Pt(111)表面におけるメタン分子の解離吸着の状態分解反応性の研究を行った。RAIRSを計測手法に導入することで、従来計測されてきた初期吸着確率だけでなく、被覆率に依存した吸着確率や飽和被覆率を決定することが可能となった。また、RAIRSによって吸着種の同定が可能になり、解離反応における結合選択性を示し

た。

これまで Pt や Ni 表面におけるメタン分子の状態分解 反応性の研究は盛んに行われており、本稿で示した反応 における結合選択性だけでなく, 振動モードの特異 性20,21),振動励起メタン分子の立体効果22,23)なども報告 されている。また. ここでは v3=1 に励起した CH4 の 反応性についての実験結果を報告したが、二つの OPO を用いて IR-IR 二重共鳴励起による 2v3 励起 CH4 の反応 性も報告されている24)。これらの詳細な実験研究はそれ 自体が反応素過程理解への知見を提供するものである。 さらには、近年発達が著しい第一原理分子動力学法をベ ースとした理論研究では個々の原子・分子の振る舞い (特に初期状態) が重要であり、非常によく定義した実 験研究はそれら理論研究結果と直接比較できるという点 でも大変意義があると思われる。最近では、Pt(111)表 面上での CHD₃ の解離吸着において実験条件を理論計算 のパラメータに組み込み、実験と理論の結果を比較する 研究も行われている25)。

さらに、水蒸気改質においてメタン分子の解離とともに重要な反応である水分子の解離についても、状態分解の反応性の研究が行われており、この反応においても振動励起が大きな役割を担っていることが報告されている²⁶⁾。

本研究は、Swiss National Science Foundation(Grant no. 134709/1)および Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne の支援の下に行われたものである。

文 献

- 1) J.H. Larsen and I. Chorkendorff: Surf. Sci. Rep. **35**, 163 (1999).
- J. Weaver, A.F. Carlssonb and R.J. Madix: Surf. Sci. Rep. 50, 107 (2003).
- 3) L.B.F. Juurlink, D.R. Killelea and A.L. Utz: Prog. Surf. Sci. **84**, 69 (2009).
- 4) R. Beck and A. Utz: "Dyn. Gas-Surface Interact. SE-8", ed. by R. Díez Muiño and H.F. Busnengo (Springer Berlin Heidelberg, 2013) p. 179.
- L. Chen, H. Ueta, R. Bisson and R.D. Beck: Rev. Sci. Instrum. 84, 053902 (2013).
- 6) D.A. King and M.G. Wells: Proc. R. Soc. London A Math. Phys. Eng. Sci. **339**, 245 (1974).
- 7) B.L. Yoder: "Steric Effects in the Chemisorption of Vibrationally Excited Methane on Nickel" (Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012).
- 8) H. Chadwick, P.M. Hundt, M.E. van Reijzen, B.L. Yoder and R.D. Beck: J. Chem. Phys. **140**, 034321 (2014).
- 9) L.B.F. Juurlink, R.R. Smith and A.L. Utz: Faraday Discuss. **117**, 147 (2000).
- 10) T. Fuhrmann, M. Kinne, B. Tränkenschuh, C. Papp, J.F. Zhu, R. Denecke and H.-P. Steinrück: New J. Phys. 7,

- 107 (2005).
- 11) D.J. Oakes, M.R.S. McCoustra and M.A. Chesters: Faraday Discuss. **96**, 325 (1993).
- 12) T. Fuhrmann, M. Kinne, C.M. Whelan, J.F. Zhu, R. Denecke and H.-P. Steinrück: Chem. Phys. Lett. **390**, 208 (2004).
- 13) H. Ueta, L. Chen, R.D. Beck, I. Colon-Diaz and B. Jackson: Phys. Chem. Chem. Phys. **15**, 20526 (2013).
- 14) A.C. Luntz and D.S. Bethune: J. Chem. Phys. 90, 1274 (1989).
- 15) A.C. Luntz: J. Chem. Phys. 113, 6901 (2000).
- R. Bisson, M. Sacchi, T.T. Dang, B. Yoder, P. Maroni and R.D. Beck: J. Phys. Chem. A 111, 12679 (2007).
- 17) R.R. Smith, D.R. Killelea, D.F. DelSesto and A.L. Utz: Science **304**, 992 (2004).
- 18) L. Chen, H. Ueta, R. Bisson and R. Beck: Faraday Discuss. **157**, 285 (2012).
- 19) D.R. Killelea, V.L. Campbell, N.S. Shuman and A.L.

- Utz: Science 319, 790 (2008).
- 20) R.D. Beck, P. Maroni, D.C. Papageorgopoulos, T.T. Dang, M.P. Schmid and T.R. Rizzo: Science **302**, 98 (2003).
- 21) P. Maroni, D.C. Papageorgopoulos, M. Sacchi, T.T. Dang, R.D. Beck and T.R. Rizzo: Phys. Rev. Lett. **94**, 246104 (2005).
- 22) B.L. Yoder, R. Bisson and R.D. Beck: Science **329**, 553 (2010).
- 23) B.L. Yoder, R. Bisson, P. Morten Hundt and R.D. Beck: J. Chem. Phys. **135**, 224703 (2011).
- 24) P.M. Hundt, M.E. van Reijzen, H. Ueta and R.D. Beck: J. Phys. Chem. Lett. **5**, 1963 (2014).
- 25) F. Nattino, H. Ueta, H. Chadwick, M.E. van Reijzen, R.D. Beck, B. Jackson, M.C. van Hemert and G.-J. Kroes: J. Phys. Chem. Lett. 5, 1294 (2014).
- 26) P.M. Hundt, B. Jiang, M.E. van Reijzen, H. Guo and R.D. Beck: Science **344**, 504 (2014).